

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年3月9日(2006.3.9)

【公開番号】特開2005-285776(P2005-285776A)

【公開日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【年通号数】公開・登録公報2005-040

【出願番号】特願2005-107007(P2005-107007)

【国際特許分類】

H 01 J	37/28	(2006.01)
H 01 J	37/20	(2006.01)
H 01 J	37/30	(2006.01)
H 01 J	37/317	(2006.01)
G 01 N	23/225	(2006.01)

【F I】

H 01 J	37/28	B
H 01 J	37/20	A
H 01 J	37/30	Z
H 01 J	37/317	D
G 01 N	23/225	

【手続補正書】

【提出日】平成18年1月20日(2006.1.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

試料室内における微小試料加工観察方法であって、

試料台に載置された試料に、イオンビームを照射して微小試料を摘出し、

第2試料台に微小試料を固定し、

第2試料台に固定されている微小試料にイオンビームを照射し、微小試料を加工し、

第2試料台に固定された微小試料が、電子ビームに対して所定の角度となるよう、第2試料台の角度を変更し、

第2試料台に固定されている微小試料に電子ビームを照射し、微小試料を測定する方法

。